

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【公表番号】特表2009-541553(P2009-541553A)

【公表日】平成21年11月26日(2009.11.26)

【年通号数】公開・登録公報2009-047

【出願番号】特願2009-517135(P2009-517135)

【国際特許分類】

C 08 F 290/06 (2006.01)

【F I】

C 08 F 290/06

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月7日(2010.4.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

この反応の完了の追跡は、例えば遊離アミンの量を測定することによって行うことができる。反応完了時点で、アミンアクリレートは残留生成物として回収することができる；しかしながら、慣用の蒸留および分別方法による回収も可能な場合もある。好ましくは、残留遊離アミンは、1000 ppm以下のレベル、さらに好ましくは500 ppm以下のレベル、特に最大で200 ppmのレベルでアミノ(メト)アクリレートから排除する。この遊離アミンの排除は、それに適したあらゆる方法、例えば減圧下に空気または窒素を用いるストリッピングなどによって行うことができる。未反応(メト)アクリレート(B)および/または(C)はアミノ(メト)アクリレートから分離することができるが、一般に(メト)アクリレート(B)および/または(C)、照射硬化性組成物にさらに使用する以前にアミノ(メト)アクリレートから分離しない。